科学研究費助成事業

研究成果報告書

	벽	ŕ成	2	8	年	6	月	29	日均	見在
機関番号:	8 2 1 1 8									
研究種目:	基盤研究(B)(一般)									
研究期間:	2012 ~ 2015									
課題番号:	2 4 3 1 0 0 7 9									
研究課題名	(和文)大強度ビームの2次元プロファイルとビームハローの超高照	感度[司時	計	測装置	置の	開発	Ś		
研究課題名	(英文)Development of a beam monitor of two dimensional beam high sensitivity for high intensity beams	n pro	ofil	le	and b	eam	ha	lo w	i th	
研究代表者										
橋本義	徳(HASHIMOTO, YOSHINORI)									
大学共同	利用機関法人高エネルギー加速器研究機構・その他部局等・その他									
研究者番	:号:1 0 3 9 1 7 4 9									

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 13,700,000円

研究成果の概要(和文): J-PARCメインリングの大強度ビームのための測定装置の具体的設計と部分的製作を行った. 内容は次の5点に要約される.(1)ビーム条件の検討及びバックグラウンドの測定から,十分な信号対ノイズ比を確認 した.(2)真空内で使うアルミ製主光学系を開発した.(3)リングの真空環境を悪化させない真空機器とインターロッ クの設計を行った.(4)ビームから見た装置のインピーダンスの計算を行い,ビームへ悪影響を及ぼす因子のないこと を確認した.(5)測定系を他のプロファイルモニターに使用しその有効性を実証した.真空容器の製作をH28年度中に 行い,大強度ビームの測定を開始する予定である.

研究成果の概要(英文): We performed the actual design and partial fabrication of this instrument for high intensity proton beams of the J-PARC Main Ring. The studied contents were summarized to five points as follows. (1) From the examination of the beam condition and the measurement of the background, we confirmed enough higher signal vs. noise ratio. (2) We developed the main optical system made of aluminum alloy to use in a vacuum. (3) We designed a vacuum system and the interlock which did not deteriorate the vacuum environment of the Main Ring. (4) We calculated the impedance of the apparatus for the circulating proton beam and it is confirmed that there was no factor which significant affects the beam. (5) We mounted the measuring equipment of a radiation-hardened image intensifier to other profile monitors and the effectiveness was demonstrated.

The vacuum chamber is under fabrication and the beam measurement will be started by the end of the H28 year with the proton beam of power of over 450kW.

研究分野: 加速器工学, ビーム診断

キーワード: 大強度ビーム プロファイル ビームモニター 非破壊 ビームハロー

1. 研究開始当初の背景

大強度陽子ビームのための非破壊型の2次元 ビームプロファイルモニターは実用化され ていなかった.筆者らはその先駆的な仕事と して,前回の科研費基盤(B)の研究において, 窒素分子ジェットを用いたシート状のター ゲットによるプロファイル検出方法の原理 検証を行った.その時点で,さらに実用化す るための研究はまだ十分に進められてはい なかった.また,本事業の申請時に提案され た,特に大強度陽子ビームで深刻な放射化を もたらすビームハローの測定を非破壊で同 時に検出する装置は,他に例を見ない先進的 なビーム診断装置となることが期待された.

2. 研究の目的

大強度陽子ビームのプロファイルを計測す る具体的な方法の確立とプロファイルの検 出と同時にビームハローを検出するための 方法の探索を行う.

3. 研究の方法

本装置の具体化にあたり,主要なテーマ5点 とそれらの研究方法は次の通りである.尚こ れは大強度陽子加速器として J-PARC メイン リング(MR)を対象としたものである.

(1) プロファイル測定時の微弱な光量の検 討について,計測環境の条件をビーム条件の 検討及びバックグラウンドの測定から明ら かにする.

(2) 直径 100mm 程度の有効視野において微弱 な光量の検出を行うための,真空内で使用す る耐放射線性を持つ金属ミラーを用いた大 口径光学系を開発するために,旋盤等の加工 機での切削基礎試験等を行う.

(3) 窒素分子ジェット(JET)とその発生装置 が加速器の周回リングの真空環境を極端に 悪化させない方法の構築.主に差動排気系と 装置の時間応答を考慮しての真空装置とイ ンターロックの基本的計算と設計を行う.

(4) リングの周回ビームに影響を与えないような装置を設計し、ビームから見たインピー ダンスの計算を行い評価する.

(5) 耐放射線性のイメージインテンシファ イアと CMOS カメラまたは CID カメラによる 測定装置の基礎試験を行い,評価する.

4. 研究成果



図 1. 装置概要(衝突チェンバー垂直断面)



図 2. 装置概要(水平断面)

最初に本研究による J-PARC MR における装置 のデザインと概要を図 1-3 に示す.衝突チェ ンバーの要素 1 の窒素分子ジェットターゲッ ト(圧力 5e-4Pa,厚み 1-3 mm)に陽子ビーム が衝突し発生する窒素分子の脱励起光を用 いてビームプロファイル(ビームコア)を2 次元で測定する.光は図中左側の要素 2-4 の 大口径光学系により衝突点の下方に集光さ れる.集光地点は大気側であり,鉛ブロック でシールドされた測定装置がセットされる. ビームハローは,衝突で電離する窒素分子か らの電子を収集して測定する.要素5の電極 と要素7の電磁石による電子収集フィールド により電子は発生点の垂直上方に導かれ,要 素6の MCP に入射して増幅される.

図2で陽子ビームは、衝突チェンバーの中心 を下方に向かう.これに対して、パルス状の ジェットが左方から入射する.ジェットの生 成装置はターボ分子ポンプとスリットを用 いた3段の差動排気系で構成される.衝突点 右方にはジェット捕獲用チェンバーがセッ トされる.衝突チェンバーには、4 方向にゲ ートバルブがセットされる.

図3に示す衝突点では、矩形で示したガスジ ェットパルス断面とその中央部に衝突する ビームコアとビームハローの断面が描かれ ている.この図では特にハローの検出方法を 模式的に示す.上述の外場(電場,磁場)に より上方に導かれた電離電子はA,Bをペアと する2組の左右のMCPで電荷増幅される.A, Bでは増幅度を独立に設定できる.MCPの後 段の波長530nmの緑色に発光する蛍光板(残 光時間<100ns)で光信号に変換される.光は 石英ガラス窓を介してファイバー光学系か らマルチアノードタイプの光電子増倍管に



図 3. 衝突点と検出装置



図 4. JET の密度分布

導かれる.最後に JET の現状を示す.本装置 で用いる JET はテストベンチで密度分布を計 測された.パルス状 JET を衝突点に相当する 位置で,スリットとカバーを付けたイオンゲ ージで測定した.結果を図 4 に示す.±10% 以下の非均一性で,80×90 mm² の領域がある ことを確認した.この面積で MR のビームを テールまでを含めて十分な領域を計測する ことが可能である.

次に本科研費における研究の主たる5項目に ついて,以下に記す.

 (1) 測定時のバックグラウンド(BG)の評価: ①ビームコアのプロファイル測定の窒素分 子の微弱な脱励起光を検出するためのイメ ージインテンシファイアの接続光学系やビ ームハロー測定の光ファイバーや光電子増 倍管(PMT)入口などでは、ビームロスにより 生成された2次粒子が計測に影響をもたらす. 本番でビームハロー信号の光転送に使用す る石英大口径光ファイバーケーブル (フジク ラSC-400/440:コア径400 µm クラッド径 440 μm, 50 m) によりビームロス信号を検出した. MR の直線部Aに位置する#2(アドレス)に, 本装置を設置することが決定しており、その 位置のビームパイプにファイバーを巻き付 けて高感度 PMT (Ultra-BiAlkari H10720) で検 出した. 380kW 程度の大強度ビームの場合に も、入射の時刻においてのみ数 mV のノイズ レベルを超えた程度の信号が見えるだけ(図 5) で、極めて低レベルの BG である. この測 定は、常時続けられている.

②Optical Stimulus Luminescence (OSL)素 子を用いたドーズ測定

MR-#2の本装置設置位置に OSL 素子をにセットし加速器運転時の主に γ線のドーズを一定期間ごとに測定している.図6に MR-#2の現在の様子を示す.ゲートバルブ(GV)に挟ま



図 5. MR 入射時のビームロス(10mV/div, 200ns/div)



図 6. MR-#2 の光ファイバーと OSL 素子 れた約 2m の区間に H28 年度に本装置が設置 される予定である. BG 測定用の石英ファイ バーが真空パイプに巻き付けられており, 図 中 0SL と示した箇所が 0SL 素子の測定位置で ある. たとえば, 2 か月間にわたり大強度ビ ームをビームパワー380~420kW で運転(計 2.8x10²⁰ 陽子の加速)した場合に, 図の鉛ブ ロックの中と外では, それぞれ 0.8/3.1Gy を 記録した. これは, MR 入射路に設置された Optical Transition Radiation (0TR)プロフ ァイルモニターのカメラを鉛ブロックでシ ールドした箇所に置いたときの測定値 1.1Gy と近い値である. このように大変ビームロス が少ない場所であることがわかった.

(2) 大口径光学系とアルミニウム製球面ミラ ーの開発:

ビームコアのプロファイルの検出では真空 内で発生する窒素分子からの微弱な脱励起 光を用いる.これを大気中の測定装置まで損 失なく導くための大口径光学系が必要にな る.我々は、すでにチタンフォイルからの 0TR を用いる2次元プロファイルモニターの開発 において、0ffner 光学系と称するオフアク



図 7. 大口径集光光学系とアルミ球面ミラー

シスの球面リレー光学システムを開発して おり, 集光率や収差が少ない利点があるため, 本装置においても Offner 光学系を採用する ことにした. OTR 装置ではパイレックスガラ ス基材を研磨して製作した凹面や凸面にア ルミニウムを蒸着して製作したが, MRの周回 の大強度ビームにおいては、放射線やビーム による電荷の誘起による電流が大きい可能 性があるために、パイレックスガラス(耐放 射線強度 < 2kGy)ではなく金属製のミラーを 開発することにした. 求められる波面精度は. λ/10 程度である. 通常の精密旋盤で切削す る方法には主に芯振れによる限界があるた めに,静圧空気軸受けを用いて固体摩擦を完 全に無くし, 空気流を層流化することで回転 ムラを排除する方法を採用した旋盤による 加工試験を行った.それでも超硬のダイヤモ ンドチップを用いても, SUS などの硬い金属 では、チップのわずかな摩耗により特に切削 速度が低速となるミラー中心部に乱れが生 じてしまう. そのためチップの摩耗を小さく するためには、ミラーサイズを小さくするか、 柔らかい金属を用いることになる. これらの 基本試験を経て、純アルミニウム(A1050)で、 乱れなく加工できる最大径としてミラーロ 径 350mm とする光学系を設計・製作すること にした. 製作したミラーの表面粗さは, Ra 30nm 程度であった (図7).

(3)ジェット並びにジェット生成装置のト ラブルが MR の真空に及ぼす影響の評価: ジェット装置を中心に本装置では,TMP を 4 台用いる.ジェットの生成におけるトラブル や TMP などの真空装置のトラブルが MR にダ メージを与えると MR 本来の目的である各種 素粒子実験に用いる大強度ビーム生成がで きなくなる恐れがある.本装置ではそれらを 避けるために細心の注意を取り,主にジェッ ト通過路におけるスリットサイズを設定し ている.また図2におけるゲートバルブ(GV) の高速遮断(<1.5 秒,実行正味 0.8s)や TMP 排気部の電磁バルブの高速応答(<0.1 秒)に より,トラブルが発生した場合でも最小限に 食い止める工夫がなされた.以下に示す重要



図 8. TMP 瞬時停止のトラブルの計算モデル



図 9. TMP トラブル時の MR の圧力変化

なトラブルの2例の評価を行い,深刻な影響をMRの真空環境に与えないことを確認した. ① MRの容器を兼ねる衝突チェンバーに隣接するTMPが瞬時停止するケース

図8には、衝突チェンバーと右隣にジェット 捕獲チェンバーが示されている. 捕獲チェン バーの TMP が瞬時にダウンした場合のシミュ レーションを行った. TMP の排気フィンが破 損するなどして瞬時に停止し、0.1 秒後にそ の排気側の電磁バルブがクローズした場合 に, TMP と電磁バルブ間の容積 0.003m³のガス 1Pa が, チェンバーに流入するケースである. 流入したガスは、 衝突チェンバーとの境界部 に設けたスリット (コンダクタンス 0.116 m³/s)を介して MR 側に流入し, 500L/s のイ オンポンプで排気される. この場合の MR で の計算された圧力変化を図9に示す.図には, 青と赤のラインが示されている.青は、スリ ット部にある GV が動作しなかった場合,赤 は 0.8s に GV がクローズした場合である. 両 者の差はほとんどない. これは, GV の動作時 間までに大部分のガスが MR に流入したこと を意味する.しかし, MR に隣接する TMP の瞬 時停止のトラブルでは, MR での圧力は, 10⁻³ Pa のオーダーまでしか悪化せず, 10 秒後に はほぼ回復することを意味している.また排 気側の電磁バルブに関してはノーマリーク ローズタイプであるために遮断できない問 題からはフリーである.

② JET 発生装置の窒素ガス導入のパルスバ ルブがクローズできないケース

図 10 に本装置のモデル化した真空容器と計 算のためのパラメータを示す. #1~#3 はジ ェット生成装置の差動排気チェンバーであ り、#4 は衝突チェンバー(MR)、#5 がジェッ ト捕獲チェンバーである. 各チェンバー間の 隔壁にスリットがセットされており, C_nのコ ンダクタンスを持つ. それぞれのチェンバー では,体積 V_n,ジェットビーム流量 Q_{Bn},チェ ンバー間圧力差によるリーク流量 Q_{Ln}, 圧力 P_n, ポンプ排気速度 STP or SIP をもつ. これ らを図に示した関係式を用いて連立させて 圧力をシミュレートした. パルスバルブがク ローズできないトラブルの場合, 窒素ガスの 流入量として 3e-2 [Pa.m³/s]を Q₁に用いた. ただし、この値はジェット発生装置での実験 より求めた値の10倍の過大な量としてある. また, 各隔壁のコンダクタンスは, 図 11 に



図10. パルスバルブがクローズできないトラ ブルの計算モデル



図 11. スリットとコンダクタンス



図 12. 各チェンバーの圧力の時間変化

示すジェット生成の役割を兼ねるスリット のサイズから計算している.計算で得た圧力 の時間変化を図 12 に示す.トラブル発生か ら1秒後にはほとんど圧力は平衡状態となり, #4のチェンバー(MR)の圧力は、2.5e-5 Paと なる.この値は MR の真空環境に大きな影響 をもたらさないことがわかった.スリットの 構成と差動排気系の効果が十分に高いこと を意味していると思われる.インターロック としてはトラブル検出後に GV をクローズさ せる対応でよい.

(4) 陽子ビームから見た装置のインピーダン ス,ウェイクフィールド等の評価:

図13に示すチェンバーとOffner 光学系を用いて,MRの周回陽子ビームから見た進行方向のインピーダンスをCSTstudioにより計算した(図14).MRの基本 RF 周波数は,1.7MHz であるためにその領域で不安定性などの問題となるような目安としての100MHz 以下で100Ω以上となるような因子は見当たらない.また,MRの設計値である750kW相当の周回ビ





100

0

0

200

400

600

Frequency [MHz]

800

1000 1200







図 16. ビーム中心軌道から 10~22.5 mm で発 生した電子が電極に到達したときのズレ がわかる. ビームバンチの通過時間に発生す るウェイクフィールドの影響によりこの程 度のズレの時間変化が生じていると考えら れる.

(5) 耐放射線性イメージインテンシファイア (I.I.)を用いたプロファイル測定装置のト ンネル内試験:

MRへのビーム入射路における OTRを用いたプ ロファイルモニターの測定装置として、本装 置の測定装置を代用させることで, 遠隔での 基本試験を行った(図17).(1)で示したよう に、本装置の設置位置 MR-#2 とほぼ同じ程度 の放射線環境であり、ローカル制御室からの ケーブル距離も400m で同じ程度である.H13 年度の本装置に関する科研費基盤(C)で開発 した耐放射線性 I.I.に高ダイナミックレン ジの CMOS カメラを取り付け, 鉛 50mm とポリ エチレン 50mm のシールドに収めている. I.I. の高圧(最大 7kV)を 50Ω系で 400m 転送す るのためには、大型の電圧可変型のパルス電 源が必要となるために, コントローラを改良 して、5V程度の入力パルスの波高でゲインも 応答するようにした. 400m 遠隔から加速器 トンネル内に送る入力パルスには、絶縁アン プを付けることでグラウンド電圧の差異に よるノイズの混入を防止した.また,放射線 に比較的強い CMOS カメラ(<2kGy)は、ギガビ ットのイーサネットで,途中光ケーブルを用



図 17. OTR プロファイルモニターの測定セットとして本装置の測定装置の試験を実施

いた LAN から操作とデータ転送を行うことに した.このような装置で,約2年にわたり OTR プロファイルモニターの測定を行っている が,高いダイナミックレンジと高いゲインに より,また雑音が極めて少ない環境での鮮明 なデータ取得を行うことができている.本装 置でもこのセットとほぼ同等の質でプロフ ァイル測定が可能になると思われる.

以上を主な研究・開発の結果として示したが、 大強度陽子加速器にトンネル内で遠隔で、放 射線も考慮したシステムにすることに関し て大きな進展があったと言える.衝突チェン バーの製作が遅れているが、H28 年度中には 製作を完了させ設置と、最初のビーム計測を 行う予定である.

<引用文献>

 橋本義徳,武藤 豪,外山 毅,"大強度 ビームのための非破壊型2次元実像ビー ムプロファイルモニターの検出器の開 発",平成18~19年度科学研究費補助金 基盤研究(B)研究成果報告書,平成22 年4月21日.

5. 主な発表論文等

- 〔学会発表〕(計3件)
- Y. Hashimoto, Y. Hori, T. Morimoto, S. Muto, <u>T. Toyama</u>, K. Yoshimura, T. Fujisawa, T. Murakami, K. Noda, D. Ohsawa, DEVELOPMENT OF A BEAM PROFILE MONITOR USING NITROGEN-MOLECULAR JET FOR INTENSE BEAMS, Proc. of IBIC12, 2012, 511-514.
- ② Y. Hashimoto, Y. Hori, T. Morimoto, T. <u>Toyama,</u> M. Uota, T. Fujisawa, T. Murakami, K. Noda, D. Ohsawa, DEVELOPMENT OF A BEAM PROFILE MONITOR USING A NITROGEN MOLECULAR JET FOR THE J-PARC MR, Proc. of IBIC13, 2013, 848-851.
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

橋本 義徳(HASHIMOTO, Yoshinori)
高エネルギー加速器研究機構・加速器研究
施設・先任技師
研究者番号:10391749

(2)研究分担者

外山 毅(TOYAMA, Takeshi)
高エネルギー加速器研究機構・加速器研究
施設・教授
研究者番号: 30207641

堀 洋一郎 (HORI, Yoichiro)
高エネルギー加速器研究機構・加速器研究
施設・教授
研究者番号: 80183937